

マスクアライメントシステム

微細パターンの作製

[型式]

ユニオン光学（株） PEM-800

[仕様]

アライメント精度： $\pm 5\mu\text{m}$ ，最大試料サイズ：3インチ ϕ

[設置年度]

1994 年度（平成 6 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日